

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 10 月 6 日 (06.10.2005)

PCT

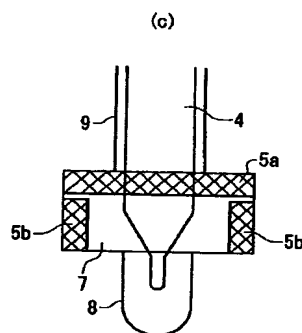
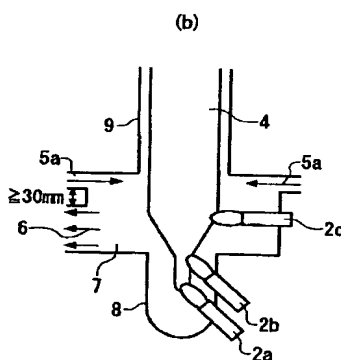
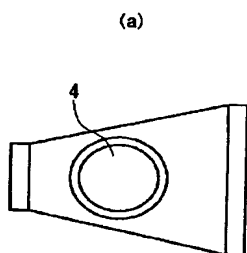
(10) 国際公開番号
WO 2005/092803 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C03B 8/04, 37/018 (74) 代理人: 龍華 明裕 (RYUKA, Akihiro); 〒1600022 東京都新宿区新宿 1 丁目 2 4 番 1 2 号 東信ビル 6 階 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/003926
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 7 日 (07.03.2005) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-094496 2004 年 3 月 29 日 (29.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越化学工業株式会社 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 乙坂 哲也 (OTO-SAKA, Tetsuya) [JP/JP]; 〒3790224 群馬県碓氷郡松井田町人見 1-10 信越化学工業株式会社内 Gunma (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: EQUIPMENT FOR PRODUCING POROUS GLASS BASE MATERIAL

(54) 発明の名称: 多孔質ガラス母材の製造装置



(57) Abstract: Equipment for producing porous glass base material capable of preventing upper surface (ceiling) of a reaction chamber from being sooted and reducing soot stripping and falling off therefrom. The equipment for producing porous glass base material (4) by depositing fine glass particles produced through flame hydrolysis reaction of material gas on a vertically arranged starting material (1) is characterized in that a plurality of suction ports (5) are provided on the sidewall of the reaction chamber provided with a deposition burner (2) along the ceiling of the reaction chamber.

(57) 要約: 反応室上面 (天井) へのススの付着を防止し、上面からの剥離・落下を低減することのできる多孔質ガラス母材の製造装置を提供する。垂直に配置された出発部材 1 に、原料ガスの火炎加水分解反応により生成したガラス微粒子を堆積させて多孔質ガラス母材 4 を製造する装置において、堆積用バーナ 2 を備えた反応室の側壁に、該反応室の天井に沿って複数の吸気口 5 を有することを特徴としている。



添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。